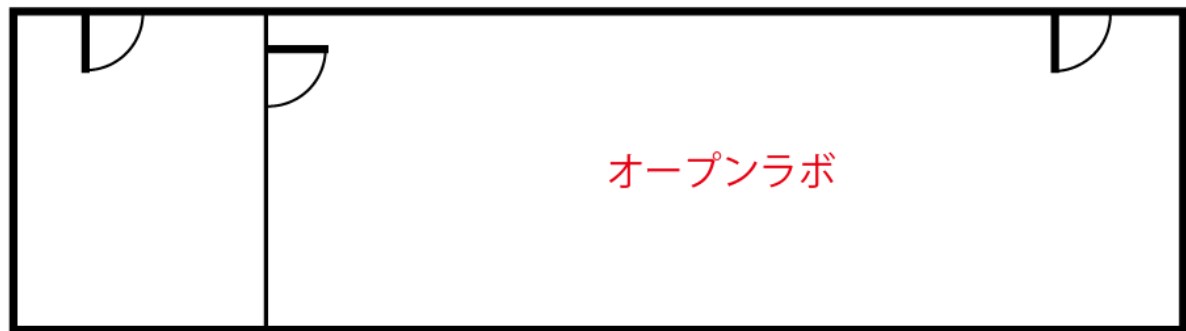
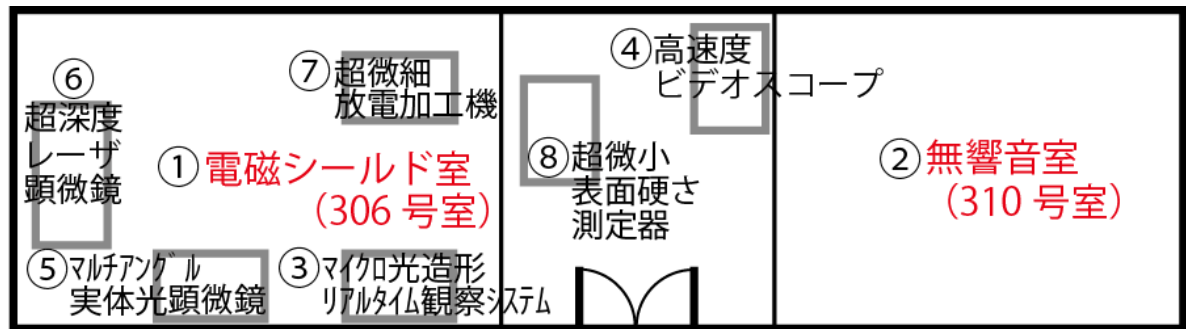


マイクロマシン研究設備 (1)

(3F 306号室、308号室、310号室)



306号室・308号室・310号室内設備配置

① 电磁シールド室



特殊なシールド材で構成されており、微弱電流や磁場の計測時に使用します。

② 無響音室



吸音材で構成された実験室で、音響実験などで使用されます。

マイクロマシン研究設備 (2)

(3F 306号室、308号室、310号室)

③マイクロ光造形リアルタイム観察システム

7 μm 径のHeCdレーザーをXYプロッターで走査する超微細光造形機です。積層ピッチは最小1 μm 、造形寸法は3mm \times 3mm \times 3mmです。

レーザー光が照射され描画が進む状況をリアルタイムで観察できます。



④高速度ビデオスコープ



最大24000コマ/秒での高速撮影が可能です。マイクروسコープ感覚で手軽に高速移動体を観察できます。

⑤マルチアングル実体顕微鏡



XY θ ステージを標準装備し、レンズを固定したまま生体組織などの蛍光観察が周囲360度から可能です。

⑥超深度レーザー顕微鏡



深さ方向の解像度が高く、微細な凹凸の測定ができます。

⑦超微細放電加工機



微小エネルギー放電と高精度の工具電極機構により、8~300ミクロンの微細穴の加工やマイクロスリットの加工が、導電性の材料への加工だけでなくシリコンなどの高比抵抗材料へも可能です。

⑧超微小表面硬さ測定機



薄膜、極微細断面の硬度測定、金属材料の受け入れや金属材料の焼入れ検査、更には電子部品などの硬度測定に威力を発揮します。